

提 案 書

平成 24 年 7 月 23 日

学術院長 殿

教育研究技師部長

氏名 浅井 吉蔵

印

下記により教員候補者の選考について、提案しますので審議願います。

記

- 1 分 野 研究設備センター先端研究設備部門における高度技術支援
- 2 職 名 教育研究技師部 学術技師
- 3 業務内容
東 8 号館(旧 SVBL)先端研究設備部門のクリーンルーム及び大小設備の維持・管理、
薬品・ガスの安全管理および実験支援
- 4 提案理由
研究基盤センター「先端研究設備部門」の施設は、平成 8 年度にサテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー設立されて以来、専攻の枠を超え多くの教員、学生がその最先端施設を活用してベンチャー創出、産学連携に関わる教育・研究を行っている。先端研究設備部門での学生、研究員、教員の研究支援、クリーンルームを含む大小 30 近くすべての設備の保守・管理を行い、利用者の薬品・ガスに関する安全教育

支援を行い、安全面での緊急時や装置の故障時の迅速な対応を行う常勤の技術職員が必要である。現在、専任教員及び担当の技術職員が不在の先端研究設備部門での政府の新成長戦略の柱となるグリーンイノベーションを含む材料・デバイス室、機械・ロボット室、光・バイオ室における教育、研究を円滑に行い、ベンチャー創出、産学連携をさらに推進し、学内外の多くの研究者に施設を有効利用してもらうには常勤の技師が不可欠である。

5 要件

- ・高等専門学校または大学を卒業して、半導体材料・デバイスプロセスの専門分野と担当業務に対して熱意を有する者。上記の専門分野と担当業務に対しての専門知識があればなお望ましい。

特定高圧ガス取扱主任者資格所持者またはあるいは、赴任後2年以内に取得予定者

赴任後に予定している業務

東8号館高圧、特殊ガスの管理支援

東8号館1、2階および3室連携ルームに設置されている30近くのすべての設備（クリーンルームを含む）の維持・管理支援

東8号館1、2階および3室連携ルームに設置されている設備の新規利用者に対して使用法を説明

必要に応じて東8号館1、2階の材料・デバイス室での教育・研究支援補助

新規利用者に対して安全教育補助（薬品、高圧、特殊ガスの扱いなど）

緊急時に対応（安全面、装置面）

装置の修理、安全点検などの立会い

施設の広報（ウェブページ、パンフレットの更新、東8号館見学者への対応、先端研究設備部門設備、研究ポスターの更新）

先端研究部門委員会への出席

先端研究部門設備利用の問い合わせ窓口業務

4 その他

次の事項を記載のこと

公募/昇任の別

公募による新規採用

配置案（専攻、コース）

研究設備センター

任用予定年月日

平成25年4月1日以降のできるだけ早い時期